

УДК 539.389.1 : 620.173.251.1

**ПЛАСТИЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ МОНОКРИСТАЛЛОВ CdTe  
и CdZnTe ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 77—300 К**

С. В. Лубенец, Л. С. Фоменко

Изучены пластические и прочностные свойства монокристаллов теллурида кадмия и его сплава с цинком (~2.5 %) в интервале температур 77—300 К. Характеристики деформационного упрочнения и термоактивационные параметры измерены в экспериментах по одноосному сжатию образцов с постоянной скоростью деформации  $4 \cdot 10^{-5} \text{ с}^{-1}$  и в режиме релаксации напряжений. Показано, что предварительная деформация кристаллов до предела текучести при компактной температуре существенно понижает температуру хрупкопластического перехода. Величина приведенного к системе скольжения предела текучести не зависит от ориентации оси сжатия. Результаты экспериментов проанализированы с целью выявления микроскопического механизма пластичности при низких температурах.

Полупроводниковые кристаллы CdTe по причине особых электрофизическими и оптическими свойств находят широкое применение в инфракрасной и электронной технике. Указанные свойства тесно связаны с дефектной структурой кристаллов и их механическими характеристиками.

Большинство работ, посвященных изучению механических свойств теллурида кадмия, выполнено с использованием метода микротвердости (см., например, [1–3]). Целью данной работы было исследование пластических и прочностных характеристик кристаллов CdTe, чистых и легированных цинком, в режиме активного нагружения и релаксации напряжений в интервале температур 77—300 К. До сих пор на эту тему было опубликовано лишь несколько работ [4–6]. Имеющиеся данные, а также результаты, полученные нами, свидетельствуют об определяющей роли потенциального рельефа кристаллической решетки в сопротивлении движению дислокаций в теллуриде кадмия. В легированных кристаллах примесные дефекты создают дополнительные сильные барьеры, ограничивающие подвижность дислокаций в плоскостях скольжения, что существенно снижает пластичность кристаллов.

### 1. Методика эксперимента

Исследования выполнены на чистых и легированных цинком (~2.5 %) монокристаллах теллурида кадмия *p*-типа, выращенных методом Бриджмена. Образцы вырезались с помощью нитяной пилы (вольфрамовая проволока  $\varnothing 0.2$  мм), смачиваемой тонким шлифовальным порошком в керосине. Границы торцы притирались на этом же порошке. Затем для удаления поврежденного слоя образцы полировали химически в растворе  $K_2Cr_2O_7$ (4 г)+ $HNO_3$ (10 мл)+ $H_2O$ (25 мл) [7]. Торцы при этом были защищены от завалов изоляционной лентой. Окончательные размеры образцов примерно  $2.5 \times 3 \times 9$  мм. Испытывали образцы нескольких ориентаций: CdTe с осью вдоль направлений [100], [110] и [111], CdZnTe с осью [123]. Для определения исходной плотности дислокаций образцы перед испытанием подвергали химическому травлению в растворах, описанных в [7]. Плотность ростовых дислокаций оказалась  $\sim 3 \cdot 10^5 \text{ см}^{-2}$ , средний размер блоков малоугловой разориентации 0.15 мм, дислокации в основ-

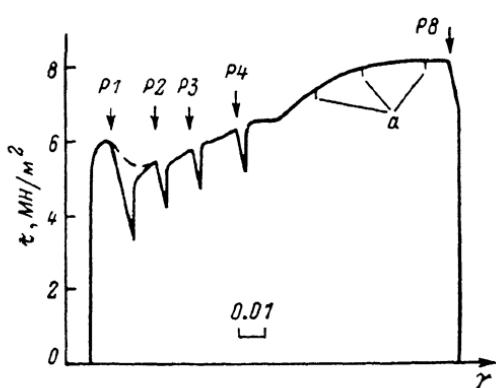
ном сосредоточены в межблочных границах. Практически все образцы содержали тонкие двойниковые прослойки, возникшие при выращивании монокристаллов.

Образцы деформировали сжатием со скоростью  $9.1 \cdot 10^{-3}$  мм/мин. Кривые релаксации напряжений записывали после достижения предела текучести вдоль всей деформационной кривой через небольшие интервалы деформации.

Учитывая чувствительность характеристик пластичности полупроводников к освещенности, эксперименты проводили в темноте.

## 2. Результаты эксперимента и их обсуждение

На рис. 1 показана типичная кривая напряжение—сдвиг для образца CdTe при комнатной температуре. Характерным здесь является наличие зуба текучести, глубина которого относительно верхнего предела текучести составляет примерно 5—10 %. Для ориентаций [100], [110] и [111] не наблюдается стадии легкого скольжения, практически сразу же за областью нижнего предела текучести следует линейное упрочнение с коэффициентом  $\theta \approx 50 \div 60 \text{ МН/м}^2$ . Начиная с деформа-



[100], [110] и [111] не наблюдается стадии легкого скольжения, практически сразу же за областью нижнего предела текучести следует линейное упрочнение с коэффициентом  $\theta \approx 50 \div 60 \text{ МН/м}^2$ . Начиная с деформа-

Рис. 1. Диаграмма деформации кристалла CdTe, ориентация [100],  $T = 300 \text{ K}$ .

$P_1, \dots, P_8$  — релаксация напряжений,  $a$  — трещины.

ции сдвига  $\gamma \approx 0.09 \div 0.1$  возникают хрупкие трещины, вызывающие быструю неглубокую релаксацию напряжений. Постепенное накопление их приводит к разрушению при деформации  $\gamma \approx 0.14$ .

Понижение температуры эксперимента характеризуется протеканием деформации без выраженного предела текучести, переходом упругого участка в стадию параболического упрочнения, резким увеличением коэффициента деформационного упрочнения (примерно в 5 раз при изменении температуры от 300 до 150 К) и сильным охрупчиванием. Так, при  $T = 77 \text{ K}$  все испытанные кристаллы разрушались без какой-либо пластической деформации, рассыпаясь в мелкофрагментированную пыль.

Диаграммы деформации кристаллов CdZnTe качественно подобны обсужденным выше для CdTe, за исключением более высокого предела текучести и деформирующих напряжений. Пластичность до разрушения при комнатной температуре примерно такая же, как и теллурида кадмия, но при понижении температуры они охрупчиваются быстрее. Для этих кристаллов с осью [123] характерно наличие протяженной стадии легкого скольжения с почти нулевым коэффициентом упрочнения. Часто наблюдается растянутый зуб текучести. Глубина зуба достигает 15 %.

На рис. 2 показана температурная зависимость предела текучести (в случае деформации с зубом текучести принято  $\sigma_t = \sigma_t^u$ , где  $\sigma_t^u$  — нижний предел текучести) для монокристаллических образцов CdTe с ориентациями оси сжатия [100], [110], [111] и CdZnTe с осью [123]. Если образцы при испытании разрушались хрупко, то определялось только  $\sigma_{vp}$  — временное сопротивление (рис. 2).

Качественно зависимости  $\sigma_t(T)$  для всех испытанных образцов имеют одинаковый характер. Чувствительность  $\sigma_t$  к температуре увеличивается начиная с  $T \approx 200 \text{ K}$ . Теллурид кадмия, легированный Zn, обладает более высокими прочностными характеристиками, чем CdTe. В то же время он

весьма хрупкий. Напряжение разрушения  $\sigma_{\text{бр}}$  увеличивается при понижении температуры так же, как и  $\sigma_t$ . Пластичность кристаллов CdZnTe в значительной степени зависит от предыстории образца. Яркой иллюстрацией этого является то обстоятельство, что недеформированные образцы хрупко разрушаются уже при 250 К. Отсутствие подвижных дислокаций в достаточном количестве предопределяет условие для зарождения и развития хрупких трещин. Это наблюдение согласуется с принятой интерпретацией зуба текучести и его связи с охрупчиванием материала. Если же образец сплава предварительно продеформировать при комнатной температуре до предела текучести, то обнаруживается пластичность ниже 200 К, т. е. температура хрупко-пластического перехода понижается более чем на 50 К.

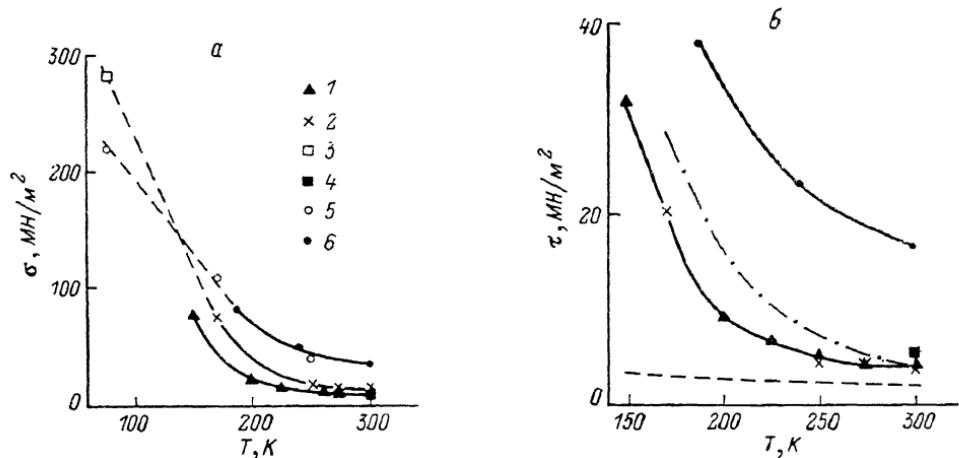


Рис. 2. Температурная зависимость пределов текучести (1, 2, 4, 6) и прочности (3, 5) кристаллов CdTe (1—4) и CdZnTe (5, 6).  
а — нормальные напряжения, б — сдвиговые. Штрихпунктирные линии — [4], штриховые — [5, 6]. Ориентация: 1 — [110], 2 — [111]; 3, 4 — [100]; 5, 6 — [123].

На рис. 2, б показаны температурные зависимости приведенного предела текучести  $\tau_r = k \sigma_r$  кристаллов CdTe и теллурида кадмия, легированного цинком. Коэффициенты Шмида имеют следующие значения:  $k=0.408$ , для ориентаций [100] и [110], 0.27 для ориентации [111] и 0.466 для ориентации [123].

Обращает на себя внимание, что приведение напряжений, отвечающих пределу текучести, к основной системе скольжения обеспечивает хорошее совпадение  $\tau_r$  для разных ориентаций образцов.

Из сопоставления наших данных с литературными видно, что кристаллы CdTe, изученные в [4], близки к нашим по своим механическим свойствам. В то же время в [5, 6] исследованы кристаллы, наиболее мягкие из известных нам по публикациям. Эти кристаллы пластически деформируются при азотных температурах и характеризуются весьма слабой температурной зависимостью предела текучести. Если для наших образцов отношение  $\tau_r(150 \text{ K})/\tau_r(300 \text{ K}) \approx 8$ , то для кристаллов из работы [5] оно составляет 1.6. Это может быть связано как с различной чистотой кристаллов, так и с отклонением от стехиометрического состава.

В работе получены кривые релаксации напряжений, соответствующие разным степеням деформации (и уровням напряжений) кристаллов CdTe и CdZnTe в интервале температур 150—300 К.

Данные по релаксации напряжений были использованы для определения величины активационного объема  $V$  [8] и его зависимости от степени деформации, температуры и напряжения.  $V$  определялся по начальному участку релаксационной кривой по формуле

$$V = kT \frac{\partial \ln(-\tau)}{\partial \tau} \Big|_{T, \tau_i}, \quad (1)$$

где  $\tau_i$  — внутреннее дальнодействующее напряжение.

Зависимость активационного объема от деформации для одного из образцов CdTe, продеформированного при комнатной температуре, показана на рис. 3. При определении  $V$  согласно (1) предполагается, что в процессе релаксации плотность подвижных дислокаций  $\rho_m = \text{const}$  и  $\tau_i = \text{const}$ . Это условие заведомо не выполняется в области зуба текучести, где падение напряжения с ростом деформации свидетельствует об увеличении плотности подвижных дислокаций [9]. В результате этого наблюдаются большая глубина релаксации, более пологая зависимость  $\ln(-\tau)$  ( $\tau$ ) и соответственно малая величина активационного объема. На более поздних стадиях деформации процесс релаксации напряжений также может сопровождаться изменениями структурного состояния кристалла, способными сделать слагаемое  $kT (\partial \ln \rho_m / \partial \tau)$ , входящее в экспериментально

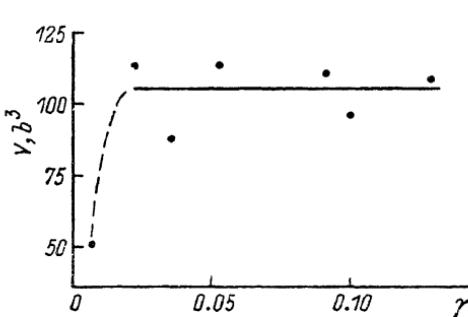


Рис. 3. Зависимость активационного объема от деформации кристалла CdTe.  $T=300$  К.

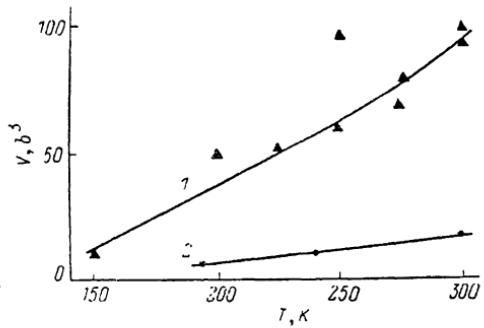


Рис. 4. Влияние температуры на величину активационного объема кристаллов CdTe (1) и CdZnTe (2).

определенную величину  $V$ , сопоставимым со значением истинного активационного объема, характеризующего подвижность дислокаций. Этот вывод следует из результатов работы [5], в которой активационный объем определялся тремя различными методами. Мы, однако, не обнаруживаем на зависимостях  $V(\gamma)$  каких-либо особенностей, кроме упомянутых и относящихся к зубу текучести. За этой областью  $V(\gamma)=\text{const}$ .

Зависимости активационного объема от температуры и напряжения для изученных кристаллов показаны на рис. 4 и 5, а. Уменьшение  $V$  с понижением температуры связано, очевидно, с ростом напряжения, при котором измеряется активационный объем. Интересно отметить, что данные, полученные на кристаллах CdTe и CdZnTe (рис. 5, а), можно уложить на единую зависимость  $V(\tau)$ . Из результатов других авторов [1, 4-6], полученных на разных кристаллах CdTe (рис. 5, б), видно, что зависимость  $V(\tau)$  близка к гиперболической. Такую зависимость можно получить из эмпирического уравнения для скорости дислокаций [10]

$$v = v_0 (\tau/\tau_0)^m, \quad (2)$$

где  $v_0$ ,  $\tau_0$  — постоянные величины; показатель степени  $m$  характеризует подвижность дислокаций. Из уравнений (1), (2) с учетом предположения, что скорость релаксации напряжений пропорциональна скорости дислокаций ( $-\dot{\tau} \sim v$ ), следует выражение для активационного объема

$$V = m k T / \tau. \quad (3)$$

Из наклона прямой (рис. 5, б), проведенной через всю совокупность экспериментальных точек, получим  $m k T = 0.26$  эВ. Тогда при комнатной температуре  $m \approx 10$  и увеличивается с понижением температуры. Отметим, что экспериментальная зависимость  $V \sim 1/\tau$ , по-видимому, показывает

лишь тенденцию изменения  $V(\tau)$  для кристаллов теллурида кадмия и должна рассматриваться как чисто качественная.

Малые значения активационного объема, полученные в описанных экспериментах, сравнение с данными других авторов для кристаллов CdTe [1, 4-6], сопоставление с результатами для элементарных полупроводниковых кристаллов [11, 12] позволяют предполагать, что в CdTe главным механизмом движения дислокаций является преодоление рельефа Пайерлса путем зарождения и расширения пар перегибов. На оба процесса (зарождение и расширение) оказывает влияние наличие локальных дефектов, присутствие которых в решетке изменяет характеристики кристаллического потенциала. Однако теоретическое рассмотрение подвижности дислокаций в рельефе Пайерлса, искаженном точечными дефектами [13],

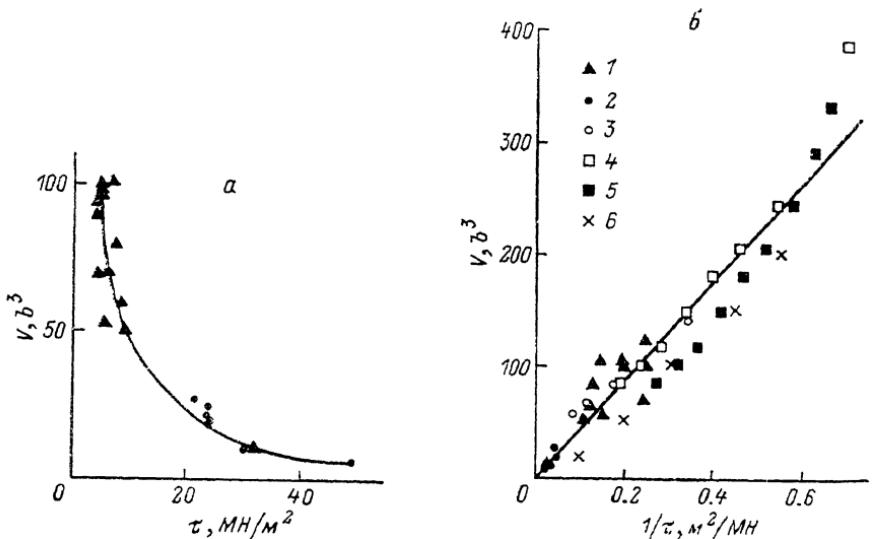


Рис. 5. Зависимости активационного объема от напряжения  $V(\tau)$  (а) и  $V(1/\tau)$  (б) для кристаллов CdZnTe (1) и CdTe (2-6).

1, 2 — част. раб.; 3 — [1]; 4 — при освещении; 5 — в темноте [6]; 6 — [4].

показывает, что в рамках перегибной модели нельзя объяснить сильное влияние примесей на величину и температурную зависимость предела текучести, которая наблюдается для кристаллов CdTe.

Изучение взаимосвязи между температурными зависимостями предела текучести и активационного объема теллурида кадмия и его сплава с цинком показало, что они не следуют из какого-либо единого физического механизма движения дислокаций. Это, очевидно, означает, что предел текучести как мера сопротивления кристалла пластической деформации и скоростная чувствительность деформирующего напряжения, измеряемая в опытах по релаксации напряжений как кинетическая характеристика пластического течения, неодинаково связаны с дислокационной структурой и динамикой дислокаций. Об этом свидетельствуют опыты по влиянию освещенности на деформирующее напряжение и активационный объем [6] и на подвижность отдельных дислокаций [14]. Особый интерес представляют последние данные. В [14] показано, что степень освещенности не влияет на скорость дислокаций. Величина активационного объема остается одинаковой на свету и в темноте [6]. В то же время деформирующее напряжение в освещенном кристалле больше. Авторы [14] полагают, что рост деформирующего напряжения обусловлен изменением структуры дислокационной линии, на которой возникают дополнительные ступеньки в результате увеличения силы взаимодействия между дислокацией и примесными дефектами, поскольку освещение изменяет электрический заряд линейных и точечных дефектов. Отсюда следует, что эффективное напряже-

ние, действующее на дислокацию, не равно приложенному. Эта разница может меняться с температурой, что и объясняет отмеченное выше несоответствие в поведении  $\tau_i(T)$  и  $V(T)$ . Определить  $\tau_i(T)$  в прямом эксперименте, к сожалению, не всегда возможно.

Таким образом, можно сделать вывод, что для описания механизма пластической деформации теллурида кадмия и его сплава с цинком необходимо привлекать представления о движении дислокаций в рельефе Пайерлса, об особенностях их взаимодействия с локальными препятствиями, а также о структуре дислокационной линии.

Авторы выражают благодарность Г. А. Шепельскому и Ю. В. Дворкину за предоставление кристаллов и В. Д. Нацкому за критическое обсуждение результатов и текста рукописи.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Курило И. В., Алексин В. П., Булычев С. И. // Препринт ИМЕТ АН СССР и ЛПИ (Львов). М., 1982. 92 с.
- [2] Гордиенко Н. Я., Новиков Н. Н., Власов В. С. // УФЖ. 1988. Т. 33. № 1. С. 78—84.
- [3] Nagabhooshaham M., Hari Babu V. // Crystal Res. and Technol. 1984. V. 19, N 5. P. 643—647.
- [4] Maeda K., Nakagawa K., Takeuchi S. // Phys. St. Sol. (a). 1978. V. 48. N 2. P. 587—591.
- [5] Gutmanas E. Y., Travitzky N., Plitt U., Haasen P. // Scripta Met. 1979. V. 13. N 4. P. 293—297.
- [6] Gutmanas E. Yu., Haasen P. // Phys. St. Sol. (a). 1981. V. 63. N 1. P. 193—202.
- [7] Инденбаум Г. В., Бароненкова Р. П., Бойных Н. М. // Физ. и хим. обраб. материалов. 1971. № 2. С. 91—96.
- [8] Dotsenko V. I. // Phys. St. Sol. (b). 1979. V. 93. N 1. P. 11—43.
- [9] Johnston W. G. // J. Appl. Phys. 1962. V. 33. N 9. P. 2716—2730.
- [10] Johnston W. G., Gilman J. J. // J. Appl. Phys. 1959. V. 30. N 1. P. 129—144.
- [11] Alexander H., Haasen P. // Sol. St. Physics. 1968. V. 22. P. 28—158.
- [12] Никитенко В. И. // Динамика дислокаций. Киев, 1975. С. 7—26.
- [13] Петухов Б. В. // Автореф. докт. дис. М., 1987. 30 с.
- [14] Nakagawa K., Maeda K., Takeuchi S. // J. Phys. Soc. Jap. 1980. V. 49. N 5. P. 1909—1919.

Физико-технический институт  
низких температур АН УССР  
Харьков

Поступило в Редакцию  
6 сентября 1988 г.